_ ЛАЗЕРНАЯ ПЛАЗМА

УДК 533.9.082.7

МОДЕЛЬ СФЕРИЧЕСКОГО ИОННОГО ДИОДА С ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫМ АНОДОМ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ

© 2021 г. А. Е. Шиканов*

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия *e-mail: aeshikanov14@mail.ru Поступила в редакцию 29.09.2020 г.

После доработки 01.11.2020 г. Принята к публикации 03.11.2020 г.

Предложена модель сферического импульсного ионного диода с лазерно-плазменным анодом для генерации нейтронов в ядерных реакциях синтеза дейтронов и тритонов. Формирование и ускорение дейтронного пакета в диоде рассматривается с учетом адиабатического механизма расширения лазерной плазмы в виде ударной волны Римана и влияния на эти процессы электростатических колебаний в области границы плазма—вакуум. По результатам компьютерного эксперимента построены и проанализированы электродинамические и нейтронные характеристики предполагаемой ускорительной трубки на базе исследуемого диода.

Ключевые слова: лазерная плазма, импульсный диод, дейтрон, генерация нейтронов, компьютерный эксперимент

DOI: 10.31857/S0367292121040090

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время появилось значительное число работ, описывающих генерацию нейтронов с применением современной лазерной техники [1-7]. Среди них особый интерес, с точки зрения создания генераторов нейтронов технологического назначения, представляют работы [3–7], где представлены результаты последних исследований малогабаритных диодных систем для генерации нейтронов при взаимодействии ускоренных дейтронов с твердыми нейтронообразующими мишенями, содержащими тяжелые изотопы водорода. Источником дейтронов служила плазма, образуемая при фокусировке импульса лазерного излучения с энергией $E_L \sim (0.1-1)$ Дж и длительностью $\tau_I \sim 10^{-8}$ с в пятно радиуса $a \sim 10^{-4}$ м на твердую мишень в виде миниатюрной таблетки из дейтерида металла или дейтерированного полиэтилена высокого давления. Мишень, в среднем, содержала $\gamma \le 2$ атомов дейтерия на один атом сопутствующего вещества - металла или углерода (коэффициент стехиометрии).

Использование ускорительных трубок (УТ), предполагаемых к разработке на основе данных, полученных в этих работах, должно существенно повысить эффективность применения нейтронных технологий при обнаружении и идентификации скрытых опасных веществ, управлении подкритическими реакторными сборками, в ядерной геофизике, радиографии и других перспективных направлениях [8, 9]. Это может быть обеспечено за счет возможности формирования стабильных во времени дейтронных пакетов с длительностью $\sim(10-10^3)$ нс и амплитудой до 10 кА, с частотой повторения до 100 Гц [10]. Указанные возможности подтверждаются физическим моделировани-ем получаемых нейтронных полей по методике, описанной в [11].

В работе [12] была предложена модель импульсного ионного диода с лазерно-плазменным анодом. Она была успешно использована при разработке, проектировании и создании вакуумных УТ [13], позволяющих генерировать рекордные для своего класса изделий импульсные нейтронные потоки в полный телесный угол с длительностью ~мкс. Для эффективной реализации ряда новых ядерных технологий требуются подобные малогабаритные УТ, работающие в более жестком импульсно-периодическом режиме с длительностью нейтронного импульса ~(10-10²) нс. Использование при их компьютерном проектировании модели, описанной в [12], затруднительно из-за невозможности корректно учитывать изменения во времени плотности ионов в плазме при малых значениях длительности ускоряющего импульса.

В данной статье предлагается модель, лишенная этого недостатка. Она, как и в работе [10], а также в ее усовершенствованном варианте [14], использует представления о разлете плазмы в виде сферической ударной волны Римана и влиянии на процесс извлечения дейтронов колебаний Ленгмюра в области границы плазма — вакуум, но более адекватно учитывает влияние объемного заряда на формирование фронта лазерной плазмы.

2. ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

В процессе образования лазерной плазмы, с параметрами, указанными выше, согласно [1, 15], примерно 70% энергии лазерной вспышки E_L переходит в кинетическую E_K и тепловую E_T энергии плазмы. Их сумма в рассматриваемом случае составляет величину

$$E = E_K + E_T \approx 0.7 E_L \le 1 \text{ Дж.}$$
(1)

Следуя работам [1, 15], будем полагать, что разлет плазмы носит автомодельный характер с нулевым градиентом плотности частиц данного сорта и полем скоростей вида

$$\mathbf{V}(r,t) = \frac{dR_{fr}(t)}{dt} \frac{\mathbf{r}}{R_{fr}(t)},\tag{2}$$

где **г** – радиус-вектор, t – время, $R_{fr}(t)$ – радиус плазменного фронта. Как и авторы монографий [1, 15], будем предполагать процесс расширения лазерной плазмы близким к адиабатическому с показателем $\gamma = 5/3$. Тогда, согласно [16], с учетом (1), приходим к приближенным выражениям

$$E_K \approx \frac{4\gamma}{\left(\gamma - 1\right)^2} E_T \approx \frac{15}{16} E; \qquad (3)$$

$$E_T \approx 0.7E_L - E_K \approx \frac{E}{16}.$$
 (4)

В процессе разлета, к определенному моменту времени t_0 , выравниваются и одновременно уменьшаются, практически до нуля, скорости ионизации и рекомбинации ионов в плазме. За это время их относительная концентрация спадает от единичного до некоторого асимптотического значения $k \le 0.1$ [1, 15]. Такой процесс принято называть "закалкой" ионизационного состояния плазмы. Ему сопутствует одновременное увеличение скорости перемещения плазменного фронта $dR_{fr}(t)/dt$ до некоторого предельного значения V_{fr} . Экспериментально установленное время "закалки" определяется формулой (см. [1, 15])

$$t_0 \approx \frac{10a}{V_{fr}}.$$
 (5)

Если для простоты предположить, что в плазме на момент завершения этого процесса содержатся, в основном, однозарядные ионы, то тепло-

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ том 47 № 4 2021

вая энергия плазменного сгустка, запасаемая в рассматриваемом случае, оценивается по формуле

$$E_T \approx 3e \frac{N_{\rm d0} \theta_0}{k} (1 + \chi^{-1}) \left[\exists \mathbf{m} \right], \tag{6}$$

где $\theta_0 = \theta(t_0)$ — температура плазмы в эВ, N_{d0} – число дейтронов в плазме на момент времени t_0 , e — элементарный электрический заряд.

На основании экспериментальных данных, приведенных в монографиях [1, 15], была получена эмпирическая зависимость начальной температуры от плотности потока энергии лазерного излучения на поверхности мишени *q*:

$$\theta_0 \approx 10^{-6} q^{4/9}.$$
(7)

С использованием формул (1), (4)–(6) и соотношения

$$q \approx \frac{E_L}{\pi a^2 \tau_L} \sim \left(10^{14} - 10^{15}\right) \mathrm{Bt/M}^2$$

получаем приближенную зависимость числа дейтронов в плазменном сгустке от параметров лазерной оптической системы на момент завершения процесса "закалки" ионизационного состояния плазмы, необходимую для дальнейшего моделирования диода :

$$N_{\rm d0} \approx 2 \times 10^{23} \frac{k \chi E_L^{5/9} a^{8/9} \tau_L^{4/9}}{\chi + 1} \sim (10^{14} - 10^{15}).$$
 (8)

Практическое отсутствие столкновений с момента t_0 позволяет рассматривать разлет ионов с различными массами независимо друг от друга. Тогда, с учетом (2) и (3), можно получить следующую связь между кинетической энергией и скоростями перемещения плазменных фронтов дейтерия и сопутствующего элемента — $V_{\rm D}$ и $V_{\rm C}$:

$$E_{K} \approx \frac{3}{2} \frac{M_{\rm D}}{R_{\rm D}^{3}} \int_{0}^{R_{\rm D}} r^{2} V(r)^{2} dr + \frac{3}{2} \frac{M_{\rm C}}{R_{\rm C}^{3}} \int_{0}^{R_{\rm C}} r^{2} V(r)^{2} dr =$$

$$= \frac{3 V_{\rm D}^{2} M_{\rm D}}{2 R_{\rm D}^{5}} \int_{0}^{R_{\rm D}} r^{4} dr + \frac{3 V_{\rm C}^{2} M_{\rm C}}{2 R_{\rm C}^{5}} \int_{0}^{R_{\rm C}} r^{4} dr = \qquad (9)$$

$$= \frac{3 M_{\rm H}}{10} V_{\rm D}^{2} + \frac{3 M_{\rm C}}{10} V_{\rm C}^{2},$$

где $M_{\rm D}$ и $M_{\rm C}$ – суммарные массы дейтериевого компонента и компонента сопутствующего ему вещества, определяемые выражениями

$$M_{\rm D} = 2M \frac{\chi N_{\rm d0}}{k}, \quad M_{\rm C} = A_{\rm C} M \frac{N_{\rm d0}}{k}, \quad (10)$$

M — масса нуклона, $A_{\rm C}$ — атомная масса элемента сопутствующего вещества, $R_{\rm D}$ и $R_{\rm C}$ — радиусы плазменных фронтов дейтерия и сопутствующего элемента.

Используя выражения (1), (3) и (8)–(10), а также формулу

$$V_{\rm C} \approx \sqrt{\frac{2}{A_{\rm C}}} V_{\rm D},$$

получаем зависимость скорости фронта дейтерия от параметров лазерной оптической системы

$$V_{\rm D} \approx 10^2 \frac{E_L^{2/9}}{a^{4/9} \tau_L^{2/9} \chi^{1/2}} \sim 10^5 \text{ M/c.}$$
 (11)

Правильность формул (8) и (11) подтверждается хорошим совпадением расчетных результатов, полученных при их использовании, с данными коллекторных и спектрометрических измерений, приводимыми в работах [17, 18].

3. ЭМИССИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЛАЗМЫ ПО ДЕЙТРОНАМ

Предельная эмиссионная способность импульсного плазменного образования, каким является лазерная плазма, определяется только ее параметрами и задается суммой термической I_T и электродинамической I_E составляющих. Первая из них характерна для классических ионных источников с фиксированной стационарной поверхностью отбора ионов и определяется для рассматриваемого случая лазерно-плазменного источника дейтронов (ЛПИД) с помощью известной формулы (см., например, [19])

$$I_{T}(N_{\rm d}, R_{\rm d}) \approx \frac{e}{4} n_{\rm d} \sqrt{\frac{4e\theta}{\pi M}} 4\pi R_{\rm d}^{2} =$$

= $15\sqrt{\frac{e^{3}}{\pi M}} \frac{a\theta_{0}^{1/2}}{N_{\rm d0}} \frac{N_{\rm d}^{4/3}}{R_{\rm d}^{2}} \approx 1.3 \times 10^{-14} \frac{a\theta_{0}^{1/2}}{N_{\rm d0}} \frac{N_{\rm d}^{4/3}}{R_{\rm d}^{2}},$ (12)

где

$$n_{\rm d} \approx \frac{3N_{\rm d}}{4\pi R_{\rm d}^3} \sim (10^{20} - 10^{24}) \,{\rm m}^{-3},$$

 $R_{\rm d}$, $N_{\rm d}$ — текущие значения концентрации дейтронов, радиуса дейтронного фронта, числа дейтронов в плазме соответственно,

$$\theta \approx \theta_0 \left(\frac{10a}{R_{\rm d}}\right)^2 \sim (0.1 - 10) \ \Im \mathbf{B}$$

 – ее температура. Последнее выражение вытекает из сделанного выше предположения об адиабатичности разлета плазмы.

Электродинамическая составляющая I_E связана с электронными колебаниями Ленгмюра в области плазменного фронта. Этот ток составляют ионы, извлекаемые из ионного шарового слоя, оголяющегося при отрицательной фазе колебаний, частота которых определяется известным (см., например, [20]) выражением

$$ω = \frac{e}{\sqrt{ε_0 m}} n_d^{1/2} \approx 54 n_d^{1/2} \sim (10^{11} - 10^{13})$$
 Γц, (13)

где *m* — масса электрона. Правомерность подобного рассмотрения подтверждается сравнением с результатами компьютерного эксперимента, опубликованными в работе [20], в котором "методом укрупненных частиц" исследовались процессы, сопровождающие сферический разлет лазерной плазмы в вакуум.

Естественно полагать, что при образовании плазмы передаваемая ей энергия лазерного излучения равномерно распределяется по степеням свободы. Следствием является соизмеримость энергии колебаний Ленгмюра, приходящейся на один электрон, с кинетической энергией дейтрона на момент t_0 . Из этого факта вытекает оценка начальной амплитуды колебаний электронов в области плазменного фронта:

$$A(t_0) \approx \sqrt{\frac{2M}{m}} \frac{V_{\rm D}}{\omega(t_0)}.$$

Выполнение условия $t_0 \ge 2\pi/\omega$ позволяет для анализа изменения амплитуды колебаний во времени использовать адиабатический инвариант

$$A(t)^{2}\omega(t) = A(t_{0})^{2}\omega(t_{0}) = \text{const}$$

В результате имеет место соотношение

$$A(t) = \sqrt{\frac{2M}{m}} \frac{V_{\rm D}}{\sqrt{\omega(t_0)\omega(t)}}.$$
 (14)

Как отмечалось выше, при отрицательной фазе колебаний Ленгмюра дейтроны в окрестности плазменного фронта оголяются и вовлекаются в процесс ускорения. Количество дейтронов, захваченных таким образом в процесс ускорения за один период колебаний, можно оценить, в предположении о нулевом градиенте дейтронной плотности, с помощью следующего приближенного соотношения:

$$\Delta N \approx 4\pi R_{\rm d}^2 A n_{\rm d} = 3 \frac{A N_{\rm d}}{R_{\rm d}}$$

Из него вытекает, с учетом (13), (14), оценка

$$I_E(N_{\rm d}, R_{\rm d}) \approx \frac{e\Delta N}{\Delta t} \approx \frac{3eAN_{\rm d}\omega}{2\pi R_{\rm d}} \approx e_{\rm d}\sqrt{\frac{M}{2m}} V_{\rm D} \frac{N_{\rm d}^{5/4}(10a)^{3/4}}{N_{\rm d0}^{1/4}R_{\rm d}^{7/4}}.$$
(15)

Общая эмиссионная способность рассматриваемого лазерно-плазменного источника дейтронов будет определяться его током насыщения:

$$I_{em}(N_{\rm d}, R_{\rm d}) = I_T(N_{\rm d}, R_{\rm d}) + I_E(N_{\rm d}, R_{\rm d}).$$
(16)

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ том 47 № 4 2021

353

4. ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УСКОРЕНИЯ ДЕЙТРОННОГО ПАКЕТА

Формирование и ускорение дейтронного пакета в диоде осуществляется под действием импульса напряжения

$$U(t) = U_m u(t - t_d),$$

где U_m — максимальное значение напряжения, u(t) — функция, задающая форму высоковольтного импульса, $t_d > t_0$ — время задержки высоковольтного импульса относительно лазерного. В последних экспериментах с диодами на базе ЛПИД (см., например, [3]) в качестве источника ускоряющего напряжения использовалась модификация генератора Аркадьева—Маркса [22]. Высоковольтные измерения показали, что ему соответствует следующая форма импульса:

$$u(t) \approx \frac{t}{t_g} \exp\left(\frac{t_g - t}{t_g}\right).$$

Параметр *t_g* означает время нарастания напряжения от 0 до максимума. Указанная зависимость будет использована в дальнейшем рассмотрении.

Процесс формирования и ускорения дейтронного пакета можно разбить на две стадии. На первой стадии ток дейтронов определяется на основании теории Богуславского–Чайлда–Ленгмюра [23, 24] известной формулой (закон "3/2"):

$$I_{BCL}(U_m,t) \approx \frac{16}{9} \pi \varepsilon_0 \sqrt{\frac{e}{M}} \frac{U(t)^{3/2}}{\alpha \left(\frac{V_{\rm D}t}{R_c}\right)},$$

где ε_0 — электрическая постоянная, R_c — радиус катода, а функция $\alpha(x)$ строится в соответствии с таблицей, представленной в монографии [24]. Зависимость числа дейтронов в плазме на этой стадии определяется формулой

$$N_{\rm d1}(U_m,t) \approx N_{\rm 0d} - \frac{1}{e} \int_0^t I_{BCL}(U_m,u) du.$$
 (17)

Вторая стадия начинается, когда ток $I_{BCL}(U_m, t)$ становится равным максимальному эмиссионному току, который может быть извлечен из плазмы. Момент t_1 перехода процесса формирования и ускорения дейтронов из первой стадии во вторую определяется из решения уравнения

$$I_{BCL}(U_m,t) = I_{em}[N_{d1}(t),V_Dt)].$$

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ том 47 № 4 2021

Неизвестные функции $N_d(t)$ и $R_d(t)$ на второй стадии должны удовлетворять системе дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dN_{\rm d}}{dt} \approx -\frac{I_{em}(N_{\rm d}, R_{\rm d})}{e} \\ \frac{dR_{\rm d}}{dt} \approx \frac{R_{\rm d}}{t} - \frac{R_{\rm d}}{3eN_{\rm d}} I_{em}(N_{\rm d}, R_{\rm d}) \end{cases}, \tag{18}$$

с начальными условиями $N_{d}(t_{1}) = N_{dl}(t_{1})$ и $R_{d}(t_{1}) = V_{D}t_{1}$.

Отрицательный член в правой части второго уравнения системы (18) определяет сокращение плазменного облака при извлечении дейтронов.

Предварительные оценки показали, что, при интересующих нас параметрах диода: $R_c < 0.1$ м, $E_L < 1$ Дж и $q \sim (10^{14} - 10^{15})$ Вт/м², – доля термической составляющей в эмиссионном токе составляет менее 1%. Это позволяет, при проведении компьютерных расчетов, пользоваться упрощенной системой уравнений, пренебрегая в (16) и (18) термической составляющей тока. После процедуры обезразмеривания расчетная система дифференциальных уравнений, с учетом (15), приобретает вид

$$\begin{cases} \frac{d\nu}{d\tau} \approx -29 \frac{\nu^{5/4}}{\rho^{7/4}} \\ \frac{d\rho}{d\tau} \approx \frac{\rho}{\tau} - 10 \frac{\nu^{1/4}}{\rho^{3/4}}, \end{cases}$$
(19)

где введены обозначения $\tau = t/t_0$, $\rho = R_d/(10a)$, $\nu = N_d/N_{d0}$.

Решение системы (19) осуществлялось на персональном компьютере методом Рунге-Кутты с видоизменением Гилла при начальных условиях

$$\nu\left(\frac{t_1}{t_0}\right) = \frac{N_{\rm d}(t_1)}{N_{\rm d0}} \quad \mu \quad \rho\left(\frac{t_1}{t_0}\right) = V_{\rm D}t_1$$

По результатам этого решения, с учетом эволюции плазменного образования на первой стадии процесса, получаем временные зависимости радиуса фронта дейтронов $R_d(t)$, их числа в плазменном сгустке $N_d(t)$, а также зависимости от времени тока дейтронов

$$I_{d}(t) = \begin{cases} I_{BCL}(U_{m},t), & t_{0} < t < t_{1} \\ I_{em} \left[N_{d0} v \left(\frac{t}{t_{0}} \right), 10a\rho \left(\frac{t}{t_{0}} \right) \right], & t_{1} \le t \end{cases}$$

На рисунках, приводимых ниже, в качестве примера представлены характерные семейства этих зависимостей, полученные для диодной системы с параметрами: $R_c = 2.5 \times 10^{-2}$ м, $a = 10^{-4}$ м,



Рис. 1. Характерное семейство зависимостей от времени числа дейтронов в плазменном сгустке. Кривая *I* соответствует значению $E_L = 1 \text{ Дж}, 2 - E_L = 0.5 \text{ Дж}, 3 - E_L = 0.2 \text{ Дж}.$



Рис. 2. Характерное семейство зависимостей от времени радиуса дейтронного фронта. Кривая *1* соответствует значению $E_L = 1 \text{ Дж}, 2 - E_L = 0.5 \text{ Дж}, 3 - E_L = 0.2 \text{ Дж}.$



Рис. 3. Характерное семейство зависимостей от времени тока ускоренных дейтронов. Кривая *1* соответствует значению $E_L = 1 \text{ Дж}, 2 - E_L = 0.5 \text{ Дж}, 3 - E_L = 0.2 \text{ Дж}.$

 $\tau_L = 20$ нс, $U_m = 2.5 \times 10^5$ В, $t_g = 50$ нс, $t_d = 30$ нс, – на базе ЛПИД, использующего лазерную мишень из дейтерированного полиэтилена высокого давления (CD₂)_n.

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ПО ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ В ДИОДЕ

Нейтронные характеристики предполагаемой УТ можно оценить, конкретизируя используемые в работе [5] соответствующие формулы для рассматриваемого диода с металло-тритиевой нейтронообразующей мишенью в виде полусферы радиуса R_c , напыленной на внутреннюю поверхность катода. В этом случае выход нейтронов за один импульс срабатывания устройства в полный телесный угол будет определяться выражением

$$N_{\rm n} \approx \frac{N_{\rm A} \rho_{\rm tg}}{2e(A_{\rm M} + 3\chi_{\rm tg})} \int_{0}^{\infty} I_{\rm d}(t) \int_{0}^{U(t)} \sigma_{\rm (d,t)}(T_{\rm d}) F(T_{\rm d})^{-1} dT_{\rm d} dt,$$

где N_A — число Авогадро, ρ_{tg} — плотность материала нейтронообразующей мишени, A_M — атомный номер металла носителя мишени, χ_{tg} — коэффициент стехиометрии материала мишени по тритию, T_d — кинетическая энергия дейтрона (кэВ),

$$\sigma_{(d,t)}(T_d) = 10^{-19} \frac{1.54}{T_d} \frac{\exp\left(-\frac{55}{\sqrt{T_d}}\right)}{3 \times 10^4 + (T_d - 96)^2} \,[\text{m}^2]$$

– сечение ядерной реакции $T(d,n)^4$ He [25], $F(T_d)$ – зависимость энергетических потерь дейтрона в мишени на единицу длины от его кинетической энергии.

В качестве примера был сделан расчет нейтронного выхода предполагаемого устройства на базе УТ с диодной системой, рассмотренной в предыдущем разделе и снабженной титано-тритиевой мишенью с коэффициентом стехиометрии $\chi_{g} = 1.5$. Энергетические потери дейтрона при этом определялись эмпирическим выражением

$$F(T_{\rm d}) = 10^9 \left(\frac{18.2\sqrt{T_{\rm d}} + 0.05T_{\rm d}}{T_{\rm d}^{1.275} + 492} + \chi_{\rm M} \frac{2.35\sqrt{T_{\rm d}}}{T_{\rm d}^{1.275} + 365} \right),$$

полученным на основе данных из монографии [26].

В процессе проведенного компьютерного эксперимента было исследовано влияние на нейтронный выход предполагаемой УТ-энергии лазерного импульса, времени задержки высоковольтного импульса относительно лазерного, амплитуды ускоряющего напряжения и времени его нарастания.

На рис. 4 представлены расчетные зависимости нейтронного выхода в полный телесный угол

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ том 47 № 4 2021



Рис. 4. Характерное семейство зависимостей нейтронного выхода от энергии лазерного импульса. Кривая *I* соответствует значению $U_m = 150 \text{ kB}, 2 - U_m = 200 \text{ kB}, 3 - U_m = 250 \text{ kB}, 4 - U_m = 300 \text{ kB}.$

от E_L , полученные для различных значений U_m , лежащих в диапазоне (150–300) кВ, при временной задержке 30 нс.

Выбранный диапазон U_m соответствует реальным условиям эксплуатации малогабаритных вакуумных УТ. Как видно из рисунка, в этом диапазоне характер зависимостей нейтронного выхода от энергии лазерного импульса близок к линейному. Причем это свойство, как показывает математический эксперимент, сохраняется в диапазоне временных задержек t_d от 0 до 100 нс.

Было обнаружено существование для каждой пары значений E_L и U_m оптимальной временной задержки, при которой нейтронный выход достигает максимума. Это иллюстрирует рис. 5, где представлены зависимости нейтронного выхода в полный телесный угол от времени задержки t_d , полученные для различных значений E_L , при $U_m = 200 \text{ kB}$.

Представленные выше семейства кривых получены для ускоряющего импульса с временем нарастания $t_g = 50$ нс. Компьютерный эксперимент показал, что его варьирование на уровне 50% от указанного значения не меняет существенным образом картину электродинамических и нейтронных характеристик рассматриваемого диода. Максимальный нейтронный выход, полученный при проведении компьютерного эксперимента в рассматриваемом диапазоне параметров, достигал значения $N = 10^{10}$ н/имп.

Полученные зависимости позволяют оценить перспективный поток нейтронов Q в полный телесный угол, который может быть получен с импульсным нейтронным генератором, использующим предполагаемую к разработке УТ, на базе рассматриваемого диода и разработанного в Ин-



Рис. 5. Характерное семейство зависимостей нейтронного выхода от времени задержки ускоряющего импульса (относительные единицы). Кривая *1* соответствует значению $E_L = 0.1 \text{ Дж}, 2 - E_L = 0.25 \text{ Дж}, 3 - E_I = 0.5 \text{ Дж}, 4 - E_I = 1.0 \text{ Дж}.$

ституте лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ компактного источника высокого напряжения на базе управляемого генератора Аркадьева—Маркса [21], способного создавать в периодическом режиме с частотой f = 10 Гц импульсы высокого напряжения с параметрами обозначенными выше. Оценка нейтронного по-

тока дает значение $Q = N \cdot f = 10^{11}$ н/с.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Предложена и разработана новая физическая модель сферического импульсного диода с лазерно-плазменным анодом для ускорения дейтронов и генерации нейтронов, использующая представления о разлете плазмы в виде сферической ударной волны Римана и влиянии на процесс извлечения дейтронов колебаний Ленгмюра в области границы плазма—вакуум.

2. В рамках предложенной модели, процесс формирования дейтронного пакета разбивается на два этапа, на первом из которых ток ионов соответствует закону "3/2", а на втором определяется только параметрами плазмы.

3. С использованием развитых физических представлений был разработан алгоритм, с помощью которого проведен соответствующий компьютерный эксперимент по исследованию временных характеристик дейтронного пакета, формируемого в диоде, а также зависимостей нейтронного выхода предполагаемой малогабаритной УТ на базе рассматриваемого диода от параметров лазерного и высоковольтного импульсов.

4. В результате компьютерного эксперимента установлено, что рассматриваемый диод при

геометрических размерах ≤ 0.1 м позволяет формировать дейтронные пакеты с амплитудой тока ~кА, с длительностью импульса на полувысоте ~10 нс.

5. В результате компьютерного моделирования нейтронных характеристик предполагаемой к разработке УТ была показана возможность генерации нейтронных потоков в полный телесный угол на уровне, превышающем — более чем на порядок — потоки, излучаемые известными вакуумными УТ.

6. Показана возможность регулирования нейтронного потока путем изменения времени задержки между лазерным и высоковольтным импульсами с выходом на оптимальное значение.

7. Погрешности определения характеристик диода и нейтронного выхода, по оценкам автора, составляют не более 10% и определяются, в основном, влиянием на формирование плазменного анода ионов сопутствующего элемента, фронт которых существенно отстает от фронта дейтронного компонента, и частичным нарушением сферической симметрии разлета плазмы. В настоящее время автор работает над усовершенствованием модели, связанным с учетом указанных факторов.

8. В дальнейшем, с целью сравнения результатов теории и эксперимента, предполагается проведение работ по макетированию диода на разработанных в Институте лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ и успешно апробированных (см., например, [3]) вакуумном и лазерном стендах.

Данная работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИ-ФИ и была доложена на 4-й Международной конференции "Лазерные и плазменные технологии, ЛАПЛАЗ-2020". Автор считает своим приятным долгом поблагодарить сотрудников кафедры "Физика плазмы" НИЯУ МИФИ за полезные обсуждения и ценные замечания, сделанные на этой конференции, а также выразить глубокую признательность покойному проф. В.А. Курнаеву за поддержку работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ананьин О.Б., Афанасьев Ю.В., Быковский Ю.А., Крохин О.Н. Лазерная плазма. Физика и применения. М.: МИФИ, 2003.
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. Plasmas. 2019. V. 26 (9). 092704.

- 3. Шиканов А.Е., Вовченко Е.Д., Козловский К.И. // Атомная энергия. 2015. Т. 119 (4). С. 210.
- 4. Шиканов А.Е., Вовченко Е.Д., Козловский К.И., Шатохин В.Л. // Письма ЖТФ. 2015. Т. 41 (10). С. 104.
- 5. Диденко А.Н., Шиканов А.Е., Ращиков В.И., Рыжков В.И., Шатохин В.Л. // ЖТФ. 2014. Т. 64 (6). С. 119.
- Диденко А.Н., Шиканов А.Е., Козловский К.И., Шатохин В.Л., Пономарев Д.Д. // Физика плазмы. 2014. Т. 40 (11). С. 1025.
- 7. Ананьин О.Б., Цыбин А.С., Козловский К.И., Шиканов А.Е. // Ат. энергия. 2013. Т. 115 (2). С. 115.
- 8. Bespalov D.F., Kolomiets N.F., Martianov I.A., Shikanov A.E. // Nucl. Geophys. 1992. V. 6 (1). P. 125.
- 9. Сб. материалов Международной научно-технической конф. "Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе". М.: ВНИИА им. Н.Л. Духова, 2004. С. 286.
- Диденко А.Н., Ращиков В.И., Рыжков В.И., Цыбин А.С., Шиканов А.Е. // Атомная энергия. 2012. Т. 112 (3). С. 189.
- 11. Kuznetsov A.Yu., Tsybin A.S., Shikanov A.E. // Radiation Physics and Chemistry. 2002. V. 64 (4). P. 257.
- 12. Shikanov A.E. // Sov. Phys. J. 1988. V. 31 (2). P. 141.
- 13. Войтенко В.А., Гулько В.М., Коломиец Н.Ф., Шиканов А.Е., Яковлев К.И. // ПТЭ. 1988. № 5. С. 34.
- Диденко А.Н., Ращиков В.И., Рыжков В.И., Шиканов А.Е. // Письма ЖТФ. 2011. Т. 37. Вып. 21. С. 70.
- 15. Быковский Ю.А., Неволин В.Н. Лазерная массспектрометрия. М.: Энергоатомиздат, 1985.
- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Физматлит, 2008.
- Вергун И.И., Козловский К.И., Козырев Ю.П., Цыбин А.С., Шиканов А.Е. // ЖТФ. 1979. Т. 49 (5). С. 2003.
- Tsybin A.S., Shikanov A.E. // Sov. Phys. J. 1985. V. 28 (8). P. 609.
- 19. Габович М.Д. Физика и техника плазменных источников ионов. М.: Атомиздат, 1972.
- Хора Х. Физика лазерной плазмы. М.: Энергоатомиздат, 1986. С. 26.
- Быковский Ю.А., Дегтяренко Н.Н., Елесин В.Ф., Кондрашев В.Е., Ловецкий Е.Е. // ЖТФ. 1972. Т. 42 (12). С. 2340.
- Вовченко Е.Д., Исаев А.А., Козловский К.И., Шиканов А.Е., Школьников Е. Я. // ПТЭ. 2017. № 3. С. 60.
- 23. *Богуславский С.А.* // Труды гос. экспериментального электротехнического ин-та. 1924. Вып. 3. 1924. С. 18.
- 24. *Форрестер А.Т.* Интенсивные ионные пучки. М.: Мир, 1992.
- 25. Власов Н.А. Нейтроны. М.: Наука, 1971.
- 26. Готт Ю.В. Взаимодействие частиц с веществом в плазменных исследованиях. М.: Атомиздат, 1978.